

日本顕微鏡学会 会員各位

時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

このたび、日本顕微鏡学会「マルチスケールトモグラフィ研究部会」主催の研究会を下記要領にて開催することになりましたのでぜひご参加下さるようお願い致します。

研究会テーマ：「FIB-SEM-SS が切り拓く最先端形態解析」

主催：日本顕微鏡学会 マルチスケールトモグラフィ研究部会

責任者：九州大学大学院工学研究院 金子賢治

開催日時：2015年12月5日（土曜日）13:00～17:00（受付開始 12:30～）

会場：工学院大学 新宿キャンパス 〒163-8677 東京都新宿区西新宿1丁目24番2号

ホームページ：<http://zaiko13.zaiko.kyushu-u.ac.jp/JSM-MSET.htm>

参加費：日本顕微鏡学会会員：2,000円、非会員：3,000円、学生：無料

交流会：参加費 2,000円程度（会場未定）

申し込み方法：添付の参加申込書に

お名前、ご所属、ご所属住所、電話番号、Fax番号、e-mailアドレス、

顕微鏡学会会員、非会員をご記入の上、e-mailにて下記申し込み先までお申し込み下さい。

申し込み先（問い合わせ・連絡先）：yamada@zaiko.kyushu-u.ac.jp

演題予定：

加藤 丈晴	JFCC	FIB-SEMによる超電導線材の3次元解析
原 徹	NIMS	直交配置 FIB-SEM の組織・形態観察へのアプリケーション
金子 賢治	九州大	FIB-SEMによる鉄鋼材料の3次元解析
太田 啓介	久留米大	(特別講演) 3D-CLEM: Live imaging と FIB-SEM3次元解析を 組み合わせた細胞相関観察法の可能性
松島 英輝	JEOL	FIB-SEMによる三次元EDSマッピングの材料分野への応用
黒田 靖	Hitachi	NX9000の最新アプリケーションの紹介
完山 正林	FEI	FIB/SEM トモグラフィ法と最近の動向